

評価

エリプソメータ

溝尻光学工業所製 DHA-XA/M8

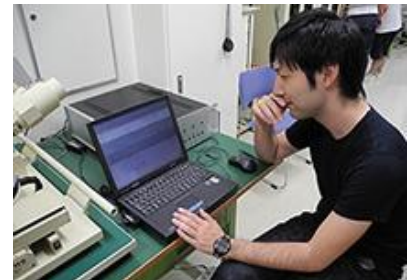
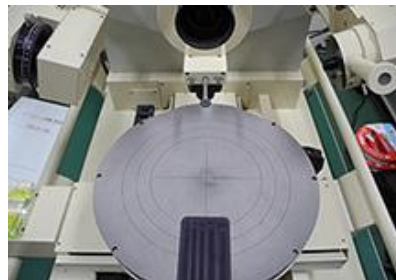
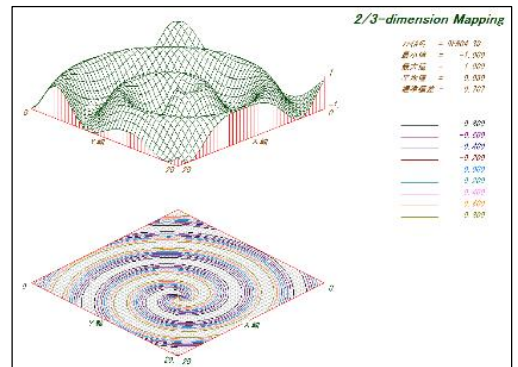
仕様

処 理 物	~12 インチウエハ
光 源 波 長	632.8nm (He-Neレーザー)
入 射 角	55° ~75° , 90°
入射角設定単位	0.01°
最 小 分 解 能	1Å
分布計測分解能	0.01mm



膜厚・屈折率計測

エリプソメータは物質表面に偏光を入射しその反射光の偏光状態を測定して物質の光学定数(屈折率・吸収係数)および表面上の薄膜の厚みと屈折率を算出するシステムです。非接触で高精度測定を行います。なお、膜厚測定範囲は数Å~数μ mです。表面の膜厚や屈折率に分布が存在している場合、多点計測により分布の取得が可能となります。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX:087-887-1873

E-mail: nanoplatfrom-c@kagawa-u.ac.jp